

Abstract

処理室内壁の汚染状況と処理室内に浮遊した異物のモニタリングを同時に行えるようにするため、また、該検出及びモニタリングを1つの観測用窓と1つのユニットで構成された光学系によって行えるようにするために、本発明では、プラズマを発生させて被処理基板を処理する装置を、内部に被処理基板をセットして観察窓を備える処理室、この処理室の内部にプラズマを発生させるプラズマ発生手段、光ビームを観察窓を通して処理室内に照射する照射手段、この照射手段により照射されて処理室の内壁で反射した光を検出する検出手段、および、この検出手段で検出して得た信号を処理することにより処理室の内壁の汚染状況の情報を得る処理手段とを備えて構成した。